PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 11064760 A

(43) Date of publication of application: 05.03.99

(51) Int. CI

G02B 26/10

G02B 26/10

G02B 13/00

G02B 13/08

G02B 13/18

(21) Application number: 09220376

(22) Date of filing: 15.08.97

(71) Applicant:

FUJI PHOTO FILM CO LTD

(72) Inventor:

SHIMADA KATSUMI NOGUCHI MASARU

IKURA MINAKO

(54) IMAGING OPTICAL SYSTEM FOR OPTICAL SCANNING DEVICE

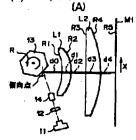
(57) Abstract:

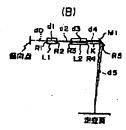
PROBLEM TO BE SOLVED: To suppress changes in lateral magnification caused by differences of the scanning angle in the auxiliary scanning direction in an imaging optical system used in an optical scanning device.

SOLUTION: This imaging optical system for an optical scanning device in which a laser beam emitted from a laser light source 11 and deflected by a high-speed rotating polygon mirror 13 is formed as an image on a scanning plane and scanned at a constant-speed consists of a positive meniscus lens L1 having a concave plane on the side of the polygon mirror 13, an anamorphic lens 12 whose the plane on the side of the polygon mirror 13 shows a concave cylindrical plane having power in the auxiliary scanning direction alone and whose the plane on the side of the scanning plane shows a convex spherical plane and has positive power in the principal scanning direction and a cylindrical mirror M1 having power in the auxiliary scanning direction alone. When the power in the principal scanning direction of the whole system is made to ϕ, the power of the anamorphic lens L12 in the principal scanning direction is made ϕ1, and the lateral magnification at the

time when scanning angle due to the polygon mirror 13 is 0 is made to M, the equation 02ϕ1/ϕ20.1 M+0.45 is made so as to be satisfied.

COPYRIGHT: (C)1999,JPO





Best Available Copy

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-64760

(43)公開日 平成11年(1999)3月5日

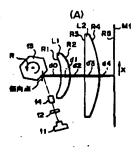
(51) Int Cl.*	識別記号	F I	
G02B 26/1	10	G O 2 B 28/10 E	
	103	103	
13/0	00	13/00	
13/0	08	13/08	
13/1	18	13/18	
		客査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 15	頁
(21) 出願番号	特度平9-22037 8	(71) 出職人 000005201	
		富士写真フイルム株式会社	
(22)出展日	平成9年(1997)8月15日	神奈川県南足柄市中和210番地	
		(72) 発明者 島田 克己	
•		神奈川県足柄上郡園成町宮台798番地	
		士写真フィルム株式会社内	
	. ·	(72) 発明者 野口 勝	
`		神奈川県足柄上郡開成町宮合798番地	Ė
		士写真フイルム株式会社内	
		(72)発明者 伊倉 美奈子	
		神奈川県足柄上都開成町宮台798番地	古
		士写真フィルム株式会社内	
		(74)代理人 升理士 柳田 征史 (外1名)	
		,	

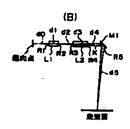
(54) 【発明の名称】 光走査装置用結像光学系

(57) 【要約】

【課題】 光走査装置に使用される結像光学系において、走査角の相違による副走査方向の横倍率変動を抑制する。

「解決手段」 レーザ光源11から出射され、高速回転するポリゴンミラー13により偏向されたレーザビームを、走査面上に結像させて等速度走査せしめるための光走査装置用結像光学系であって、ポリゴンミラー13側に凹面を有する正メニスカスレンズL1と、ポリゴンミラー13側の面が副走査方向にのみパワーを有する凹シリンドリカル面を呈し、走査面側の面が凸球面を呈し、主走査方向に正のパワーを有するアナモルフィックレンズL2と、副走査方向にのみパワーを有するシリンドリカルミラーM1とからなる。全系の主走査方向のパワーをφ、アナモルフィックレンズL2の主走査方向のパワーをφ1、ポリゴンミラー13による走査角がゼロのときの機倍率をMとしたとき、「0≦φ1/φ≦0.1|M|+0.45」を満足するようにする。





【特許請求の範囲】

【請求項1】 偏向器により偏向された光束を所定の走 査面上に結像するとともに該走査面上で等速度走査せし めるための光走査装置用結像光学系であって、

1

前記結像光学系が、前記偏向器の面倒れを補正するため のアナモルフィックレンズを備え、

数アナモルフィックレンズの主走査方向のパワーを

ø1、前配結像光学系の全系の主走査方向のパワーを

φ、前配偏向器による偏向角がゼロのときの横倍率をM としたとき、下配の式を満足するものであることを特徴 10 とする光走査装置用結像光学系。

 $0 \le \phi_1/\phi \le 0.1 |M| + 0.45$

【請求項2】 前記結像光学系が、下配の式を満足する ものであることを特徴とする請求項1記載の光走査装置 用結像光学系。

 $0 \le \phi_1/\phi \le 0.1 |M| + 0.35$

前記結像光学系が、正メニスカスレンズと、前記アナモルフィックレンズと、副走査方向にのみパワーを有する 20シリンドリカルミラーとを、前配偏向器からこの頃に配設したものであることを特徴とする請求項1または2記載の光走査装置用結像光学系。

【請求項4】 前配正メニスカスレンズが、プラスチック材料により形成されたものであることを特徴とする請求項3記載の光走査装置用結像光学系。

【請求項5】 前配正メニスカスレンズが、少なくとも 1 面が非球面であるものであることを特徴とする請求項 3 または4 記載の光走査装置用結像光学系。

【請求項6】 前記アナモルフィックレンズの前配偏向 30 器側の面が副走査方向にのみパワーを有する凹シリンド リカル面であり、該アナモルフィックレンズの被走査面 側の面が凸球面であることを特徴とする請求項1から5 何れか1項記載の光走査装置用結像光学系。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はレーザビーム等の光 東を偏向して所定の面上に走査せしめる光走査装置に使 用される結像光学系に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来より、回転多面鏡を使用した偏向器によって反射偏向される光ビームにより光走査を行う光走査装置がよく知られている。この種の光走査装置はレーザービームを使用する記録装置や読取装置に用いられているが、その構成は、レーザービームを出射する光源と、この光源から出射された光束を偏向する回転多面鏡と、偏向された光束を所定の走査面上で結像せしめるとともに回転多面鏡による偏向角と結像された像の像高とが比例するように形成されたf θ レンズを用いた結像光学系とからなる。

【0003】このような回転多面鏡を使用する偏向器に より走査偏向を行う光走査装置においては、偏向器の面 倒れによる走査線の位置誤差を補正する一手法としてア ナモルフィックレンズを用いた面倒れ補正光学系が知ら れている。図10は、この面倒れ補正光学系を適用した結 像光学系の一例を示したものであり、この光学系は、偏 向器50と、プラスチックで形成された正メニスカスレン ズ52と、ガラスで形成されたアナモルフィックレンズ54. とを順に配設したものである。このように、ブラスチッ クレンズとガラスレンズとを組み合わせて光学系を構成 することにより、プラスチックレンズのパワー(屈折 力)を小さくすることができ、その結果、プラスチック レンズの偏肉比の増大を抑止してプラスチックレンズの 環境変化による光学特性の変化を抑えたり、加工適性を 向上させることができ、さらには、光学系のサイズをコ ンパクトに維持するとともに、高性能な収差特性、f. 6 性を得ることができるものである。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】ところで、このアナモルフィックレンズを用いた面倒れ補正光学系では、主走査方向にパワーを持つアナモルフィックレンズに面倒れ機能を持たせるために、走査角によって副走査方向の横倍率が変動してしまう。これは、レンズの中央部と周辺部とでその肉厚の比(偏肉比)の増大があることが主な原因である。

【0005】図11は、面倒れ補正光学系を適用した結像 光学系の横倍率とビーム径の関係を示す図である。副走 査方向の像面(走査面)上での結像ビーム径Wは、副走 査方向の入射ビーム径をWiとし、横倍率を走査角の関 数M(θ)とすると、以下の式で表すことができる。

[0006] Wo=M(θ)×Wi

従って、横倍率M(θ)が走査角θによって変動すると走査面上での副走査方向のビーム径Woが走査角θによって変動し、均一なスポットが得られなくなるという問題を生じる。

【0007】本願発明は上記事情に鑑みなされたものであって、アナモルフィックレンズを用いた面倒れ補正光学系を適用した光走査装置用結像光学系において、横倍率変動を抑えることのできる光学系を提供することを目的とするものである。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明にかかる光走査装置用結像光学系は、偏向器により偏向された光束を所定の走査面上に結像するとともに該走査面上で等速度走査せしめるための光走査装置用結像光学系であって、前記結像光学系が、前記偏向器の面倒れを補正するためのアナモルフィックレンズを備えるものとし、該アナモルフィックレンズの主走査方向のパワーをφ、前記には学系の全系の主走査方向のパワーをφ、前記偏向器による偏向角がゼロのときの横倍率をMとしたとき、式「0

≦ φ1/φ≦0.1|M|+0.45」を満足するものとして、これにより走査角の相違による横倍率変動を略23%以下に抑えたことを特徴とするものである。

3

【0009】また、上配結像光学系が、さらに式「0≤ ϕ_1/ϕ ≤0.1|M|+0.35」を満足するものとして、走査 角の相違による横倍率変動を略20%以下に抑えることが 好ましい。

【0010】また、本発明にかかる光走査装置用結像光学系においては、前配アナモルフィックレンズが主走査方向に正のパワーを有するものとし、上配結像光学系が、正メニスカスレンズと、前配アナモルフィックレンズと、副走査方向にのみパワーを有するシリンドリカルミラーとを、前配偏向器からこの順に配設したものとすることが望ましい。

【0011】ここで、前配正メニスカスレンズが、ブラスチック材料により形成されたものとしたり、或いは、少なくとも1面が非球面であるものとすれば、なお好ましい。

【0012】また、本発明にかかる光走査装置用結像光 学系においては、前配アナモルフィックレンズの前配偏 20 向器側の面が副走査方向にのみパワーを有する凹シリン ドリカル面であり、該アナモルフィックレンズの被走査 面側の面が凸球面であるものとすることが望ましい。 【0013】

【発明の効果】本発明にかかる光走査装置用結像光学系は、アナモルフィックレンズの主走査方向のパワφ1と結像光学系の全系の主走査方向のパワーφとの比φ1/φが、上述のような所定の条件を満足するようにしたことにより、走査角の相違による模倍率変動を略23%以下、更には20%以下に抑えることが可能となる。

【0014】また、プラスチックレンズ(正メニスカスレンズ)とガラスレンズ(アナモルフィックレンズ)とを組み合わせた構成とすることもできるから、本発明にかかる結像光学系のサイズをコンパクトに維持するとともに、高性能な収差特性、f9性を得ることも可能となる。

【0015】ここで、アナモルフィックレンズの主走査方向のパワφ1と結像光学系の全系の主走査方向のパワー・をの比(パワー比)φ1/φが、上述のような式を満足するものとすれば、走査角の相違による横倍率変動を40略23%或いは略20%以内に抑制できる理由について図12を参照して簡単に説明する。図12は、偏向器による偏向角(走査角)がゼロのときの機倍率(以下「軸上横倍率」と称す。)Mが、それぞれ-0.5倍、-1.0倍、-1.5倍の場合に、パワー比φ1/φを変化させたときの走査角による機倍率変動のシミュレーション結果を示したものであり、軸上横倍率Mが-0.5倍のものを無い破線で示し、軸上横倍率Mが-1.0倍のものを実線で示し、軸上横倍率Mが-1.5倍のものを荒い破線で示している。また、各線上の番号a~hを付した三角、四角、菱形の各マーク50

は、後述の実施の形態にかかる結像光学系のものを示し ている。

【0016】この図12より明らかなように、軸上横倍率Mの相違によって若干の差があるものの、アナモルフィックレンズの主走査方向のパワーが強くなる(パワー比が大きくなる)に従って横倍率変動も大きくなる傾向がある。したがって、例えば、横倍率変動を23%以下に抑えるには、軸上横倍率Mが-0.5倍のときパワー比を約0.55以下、軸上横倍率Mが-1.5倍のときパワー比を約0.6以下にする必要があることが判る。軸上横倍率の違いによる差はほぼ比例関係にあるから、これらの条件から横倍率変動を23%以下に抑えるための条件式「0≤φ1/φ≤0.1|M|+0.45」が導かれる。

【0017】同様にして、横倍率の変動を20%以下に抑えるには、軸上横倍率Mが-0.5倍のときパワー比を約0.4以下、軸上横倍率Mが-1.5倍のときパワー比を 約0.5以下にする必要があり、横倍率変動を20%以下に抑えるための条件式「0≤φ1/φ≤0.1|M|+0.35」が導かれる。

[0018]

【発明の実施の形態】以下、本発明の光走査装置用結像 光学系の具体的な実施の形態について図面を用いて詳細 に説明する。

【0019】図1は本発明にかかる結像光学系の第1の 実施の形態を使用した光走査装置の概略構成を示す主走 査断面図(A) および該結像光学系のみについて示した副 走査断面図(B) である。 (以下に述べる他の実施の形態 等においても同様である。) 図示の光走査装置は、レー ザビームを出射するレーザ光源11と、光源11から出射さ 30 れた出射光を平行光線束とするコリメータレンズ12と、 コリメータレンズ12を通過した平行光線束を偏向器であ るポリゴンミラー13の偏向面近傍に線像を結ぶように配 置したシリンドリカルレンズ等の入射光結像光学系14 と、図示しないモータにより軸回りに回転せしめられて 入射光結像光学系14を通過して偏向面(反射面)に入射 した光束を本実施形態にかかる結像光学系の方向に偏向 せしめるポリゴンミラー13と、この偏向されたレーザビ ームを所定の走査面上に結像するとともにこの走査面上 で等速度走査せしめる結像光学系とからなる構成であ

【0020】ここで、この光走査装置に使用される結像 光学系は、ポリゴンミラー13側に凹面を有するプラスチック材料により形成された両面が共に非球面の単レンズ である正メニスカスレンズL1と、主走査方向に正のパワーを有するガラス材料により形成されたアナモルフィックレンズL2と、副走査方向にのみパワーを有するシリンドリカルミラーM1とからなる構成である。また、アナモルフィックレンズL2は、ポリゴンミラー13側の面が副走査方向にのみパワーを有する凹シリンドリカル面を呈 50 し、走査面側の面が凸球面を呈している。

【0021】ここで、本実施形態の結像光学系の具体的 な、正メニスカスレンズL1の各レンズ面およびアナモル フィックレンズ1.2の各レンズ面およびシリンドリカルミ ラーM1の曲率半径R[m]と、偏向点から正メニスカスレ ンズL1までの光軸上における空気間隔、正メニスカスレ ンズL1の中心厚、正メニスカスレンズL1からアナモルフ イックレンズL2までの光軸上における空気間隔、アナモ ルフィックレンズ12の中心厚、アナモルフィックレンズ L2からシリンドリカルミラーM1までの光軸上における空 気間隔、およびシリンドリカルミラーM1から走査面まで 10 示す非球面であることを意味するとともに、その数値は の光軸上の空気間隔(これら総称して軸上面間隔とい う;以下、同じ) d [cm] と、正メニスカスレンズL1およ*

*びアナモルフィックレンズL2の屈折率(d線;以下、同 じ)とを表1に示す。

6

【0022】なお、表中の曲率半径R、軸上面間隔dに それぞれ付された添字は偏向点側から順次増加するよう に設定され、図1に記載されたものに対応している。

【0023】また曲率半径Rの数値の符号は偏向点側に 凸の場合を正、走査面側に凸の場合を負とする。

【0024】さらにまた、曲率半径Rの数値の後に

「*」印の付されたものは、その面が以下の式(1)で 光軸上(非球面の頂点)での曲率半径を示している。

[0025]

$$z = ch^2 / [1 + (1 - (1 + K) c^2 h^2)^{1/2}]$$

 $+a_1 h^4 + a_2 h^6 + a_3 h^8 + a_4 h^{10} \cdots (1)$

但し、z:光軸からの高されの非球面上の点より、非球 面頂点の接平面(光軸に垂直な平面)に下ろした垂線の 長さ

h:光軸からの高さ c:非球面頂点での曲率

K;円錐定数

a1~a4;第4次、第6次、第8次、第10次の各非球 面係数

一方、屈折率は、軸上面間隔d1に対応する欄に記載さ れた n1 が正メニスカスレンズL1の屈折率 軸上面間隔 d3に対応する欄に記載されたn3がアナモルフィック レンズ1.2の屈折率を示す。

※【0026】そして、この結像光学系は、その全系の主 走査方向のパワーをφ、アナモルフィックレンズL2の主 走査方向のパワーを 41、ポリゴンミラー13による偏向 角(走査角)がゼロのときの横倍率をMとしたとき、M =-0.1、パワー比φ1/φ=0.54であり、下記式(2)を 20 満たすもの、即ち、横倍率変動を23%以下に抑えるもの である(図12の四角マークaを参照)。

[0027]

 $0 \le \phi_1/\phi \le 0.1 |M| + 0.45$

[0028]

(表1)

軸上標倍率: M=-1.0 パワー比 : めょ/め=0.64

由本半径R	物上面間隔d	屈折率の	備考
R 1 = -148.564 K = -14.644 a 1 = -0.10281 I-05	d = 34.18		
a:= 0.63248 I-09 a:= 0.31298 I-12 a:= 0.39528 E-16	d ;=20.84	n:=1.628760	
R 2 = -93.193 * K = 1.3152 a ₁ = -0.37030 E-07			
a. = 0.816683E-10 a. = 0.134247E-13 a. = -0.836880E-17	d :=31.55		
R3=-43.493 ;劇 = ∞ ;主	d .=32.00	n,=1.614977	
R 4 =-238.697	}- <u></u> -		
R 5=-172.020	d .= 77.22		СУМЫ
	d = 181.53		

中: 非越图

【0029】次に本実施形態の結像光学系の作用につい て説明する。レーザ光源11からレーザビームが出射さ

れ、このレーザビームはコリメータレンズ12により平行 50 光線束とされた後、入射光結像光学系14によりポリゴン

7

ミラー13の反射面上に線像として結像せしめられる。

【0030】ポリゴンミラー13の反射面により反射せしめられたレーザピームは、正メニスカスレンズにおよびアナモルフィックレンズに2を通過してシリンドリカルミラーM1により反射偏向せしめられ、走査面上に集光されてこの走査面上で走査スポットを形成する。ポリゴンミラー13は軸回りに矢印R方向に高速回転されるため、この走査スポットはシリンドリカルミラーM1面上を矢印X方向に繰り返し主走査する。この走査スポットはシリンドリカルミラーM1により反射偏向されるから走査面上に 10おいても繰り返し主走査されることになる。

【0031】本実施形態の結像光学系による像面湾曲図を図2(A)に、f θ 特性図を図2(B)に示す。なお、像面湾曲図(図2(A))において、実線は主走査方向の像面湾曲の特性を示し、破線は副走査方向の像面湾曲の特性を示す(以下に述べる他の実施の形態等においても同様である。)。図示のグラフによれば本実施形態の結像光学系は良好に収差補正がなされており、またf θ 性も良好であることが認められる。

【0032】このように本実施形態の結像光学系は、ア 20 ナモルフィックレンズの主走査方向のパワーを式 (2) に示す範囲に抑制したため、走査角の違いによる横倍率の変動を抑えることができる。また、プラスチック材料からなる正メニスカスレンズとガラス材料からなるアナモルフィックレンズと、シリンドリカルミラーとを組み合わせた構成としているから、プラスチックレンズの偏肉比の増大をある程度抑止してプラスチックレンズ自体の加工適性を向上させることができると共に、周囲の温度変化等の環境変化でレーザービームの焦点位置が変動

するのを軽減することもできる。

【0033】次に、表2並びに図3に、本発明にかかる 結像光学系の第2の実施の形態を示す。なお、図3(A)は この第2の実施の形態にかかる結像光学系の主走査断面 による構成図を示し、図3(B)は副走査断面による構成図 を示す。また、図3(C)は像面湾曲特性を、図3(D)はf θ 特性をそれぞれ示す。(図4以降についても同様であ る。)

この第2の実施の形態にかかる結像光学系の基本的な構成は前述の第1の実施の形態と同様に、ポリゴンミラー13側に凹面を有するプラスチック材料により形成された 両面が共に非球面の単レンズである正メニスカスレンズ L1と、主走査方向に正のパワーを有するガラス材料により形成されたアナモルフィックレンズL2と、副走査方向にのみパワーを有するシリンドリカルミラーM1とからなる構成であって、アナモルフィックレンズL2は、ポリゴンミラー13側の面が副走査方向にのみパワーを有する凹シリンドリカル面を呈し、走査面側の面が凸球面を呈している。

【0034】この第2の実施の形態にかかる結像光学系は、軸上横倍率がM=-1.5となるようにアナモルフィックレンズの凹シリンドリカル面の曲率半径とシリンドリカルミラーの曲率半径とを変更したものであり、M=-1.5、パワー比φ1/φ=0.54であるから、前述の式

(2) の条件を満たすもの、即ち、横倍率変動を23%以下に抑えるものである(図12の三角マーク b を参照)。 【0035】

【表2】

10

9

軸上機倍率;M=-1.5

パワー比 : めょ/ 6=0.54

曲率半径及	軸上面影隔 d.	回折率カ	# 考
R 1 =-148.564* K =-14.644	d.=34.18		
a:=-0.10281 E-05 a:= 0.63246 E-09 a:=-0.31298 E-12 a:= 0.39528 E-16	d 1=20.94	n ₁ =1.528750	
R 2 == -93.193 = K = 1.3152 e. = -0.37030 E-07			
a. = 0.816883E-10 a. = 0.1342478-13 a. ==0.836380E-17	d.=31.55		
R3=-43.916 ;副 = ∞ ;主			
R 4 = -238,697	d = 32.00	n=1.614977	
	d.=9.53		-
R 5 = -152.818	d.=184.74		СУМБ
			韓田

*: 非球面

【0036】したがって、この第2の実施の形態にかかる結像光学系も横倍率の変動を23%以下に抑えることができ、また、像面湾曲図およびf 6特性図のグラフによれば本実施形態の結像光学系も良好に収差補正がなされており、またf 6性も良好であることが認められる。

【0037】次に、表3並びに図4に、機倍率の変動を20%以下に抑えた、本発明にかかる結像光学系の第3の実施の形態を示す。この第3の実施の形態にかかる結像30光学系の基本的な構成は前述の第1の実施の形態と同様に、ポリゴンミラー13側に凹面を有するプラスチック材料により形成された両面が共に非球面の単レンズである正メニスカスレンズL1と、主走査方向に正のパワーを有するガラス材料により形成されたアナモルフィックレンズL2と、副走査方向にのみパワーを有するシリンドリカルミラーM1とからなる構成であって、アナモルフィック

レンズL2は、ポリゴンミラー13側の面が副走査方向にの みパワーを有する凹シリンドリカル面を呈し、走査面側 の面が凸球面を呈している。

【0038】この第3の実施の形態にかかる結像光学系は、軸上横倍率がM=-1.0でアナモルフィックレンズの主走査方向のパワー比が低くなるように設計したものであり、M=-1.0、パワー比φ₁/φ=0.34であるから、以下の式(3)の条件を満たすもの、即ち、横倍率変動を20%以下に抑えるものである(図12の四角マークcを参照)。

【0039】 0≤¢₁/¢≤0.1|M|+0.35 ····(3) 【0040】 【表3】

特別平11- 64760

12

帕上餐倍率:M=-1.0

11

パワー比 : ø :/ ø = 0.34

曲字半径及	軸上周國際 d	屈折率 n	備考
R 1 = -178.108 + K = -23.840 a. = -0.10387 E-05	d.=35.00		
a. = 0.40783 E-09 a. = -0.22064 E-12 a. = 0.12564 E-16	d:=33.97	n:=1.526760	
R 2 = -58.828 K = 1.1038 a = 9.27541 E-07			
a. = -0.19677 E-11 a. = 0.21825 E-13 a. = -0.51223 E-17	d,=32.45		
R 3 = -62.690 ; 副 = ∞ ; 主	ļ		
R 4 = -384.044	d.=30.00	n:=1.014977	
	d.=30.19		
R 5 =-172.664	du=157.78		CYM面
	== 1,3,1,10	i	像面

字: 非戏团

【0041】この第3の実施の形態にかかる結像光学系は横倍率の変動を20%以下に抑えることができ、また、像面弯曲図およびf 6 特性図のグラフによれば本実施形態の結像光学系も良好に収差補正がなされており、またf 6 性も良好であることが認められる。

【0042】次に、表4~8並びに図5~9に、横倍率 変動が23%以上になる結像光学系の形態を示す。表4~8 および図5~9の各図(A)、(B)に示す結像光学系の基30本的な構成は前述の第1の実施の形態と同様に、ポリゴンミラー13側に凹面を有するプラスチック材料により形成された両面が共に非球面の単レンズである正メニスカスレンズL1と、主走査方向に正のパワーを有するガラス材料により形成されたアナモルフィックレンズL2と、副走査方向にのみパワーを有するシリンドリカルミラーM1

とからなる構成であって、アナモルフィックレンズL2 は、ポリゴンミラー13側の面が副走査方向にのみパワー を有する凹シリンドリカル面を呈し、走査面側の面が凸 球面を呈している。

【0043】表4および図5(A),(B)に示す結像光学系は、軸上横倍率がM=-0.5でアナモルフィックレンズの主走査方向のパワー比が低くなるように設計したものであり、M=-0.5、パワー比φ1/φ=0.54であるから、式(2)の条件を満たすことができず、横倍率変動を23%以下に抑えることができない(図12の菱形マークdを参照)。

【0044】 【表4】

14

軸上横倍率: M=-0.5 パワー比 : ø:/ø=0.64

曲字半径R	軸上回動開せ	無折半n.	備考
R 1 = -148.564 = K = -14.844 a = -0.10281 R-05	d•=34.18		
a = 0.63248 E-09 a = -0.31298 E-12 a = 0.39528 E-16	d:=20.94	n:=1.526750	
R 2 = -93.193 + K = 1.3162 5.1 = -0.37030 R-07			
a = 0.816683E-10 a = 0.134247E-13 a = -0.836880E-17	d.=31.55		
R3=-44.002 ; 副 = ∞ ;主			
R 4 = -238.697	d:=82.00	n,=1.814977	
R 5 =-178.662	d = 77.22		
20-110,002	d.=117.05		CYMM
			像国

*:非球目

【0045】また、表5および図6(A)、(B)に示す結像 光学系は、アナモルフィックレンズL2の副走査方向の曲 率半径およびシリンドリカルミラーM1の曲率半径を変更 したものであり、M=-1.0、パワー比 $\phi_1/\phi=0.71$ であ るから、式(2)の条件を満たすことができず、横倍率*

13

*変動を23%以下に抑えることができない(図12の四角マークeを参照)。

[0046]

【表5】

・ 第上権併率:M ==1.0 パワード・メンチョル デ

#1467:M=-1.0		E : φι/φ=0.71	
曲率半径R	触上面関隔 d	田折率カ	第 号
R 1 =-109.024 + K =-1.4243 a i =-0.10257 E-05	d.=36.50		ļ
a = 0.78737 E-09 a = -0.28244 E-12 a = 0.68860 E-17	d:=14.40	n.=1.526750	
R 2 = -87.901 + K = 1.3381 a = -0.25256 E-08			
a = 0.21942 E-09 a = 0.17568 E-13 a = -0.118285E-16	d:=28.80		
R3 = -43.378 ; 幽 □ ∞ ; 主			
R 4 = -180.688	d = 32.00	n.=1.614977	
R 5 =-181.903	d.=40.15		CYME
	d == 165.25		A E

中:非绿面

【0047】また、表6~8および図7~9の各図 50 (A), (B)に示す結像光学系も、正メニスカスレンズL1,

15

アナモルフィックレンズL2の副走査方向およびシリンドリカルミラーM1の各曲率半径を変更したものである。
【0048】ここで、表6および図7(A),(B)に示す結像光学系は、M=-0.5、パワー比φ1/φ=0.92であり(図12の菱形マークfを参照)、また、表7および図8(A),(B)に示す結像光学系は、M=-1.0、パワー比φ1/φ=0.92であり(図12の四角マークgを参照)、さら *

*に、表8および図9(A),(B)に示す結像光学系は、M=-1.5、パワー比φ1/φ=0.92である(図12の三角マークトを参照)から、何れも式(2)の条件を満たすことができず、横倍率変動を23%以下に抑えることができない。

16

【0049】 【表6】

軸上機倍率: M=-0.5

パワー比 : øi/ø=0.92

曲字半径及	軸上面随隔 d	屈折率n	用号
R 1 =-105.513+ K =-1.0715 a ₁ =-0.11059 R-05	d.=39.00	ŕ	
a = 0.80000 E-09 a = -0.19827 E-12 a = 0.10760 E-16	d:=15.00	n.=1.528750	
R 2 =-106.424 + K = 1.2966 a =-0.34827 I-06			
a. = 0.23039 B-09 a. = -0.45024 B-14 a. = -0.24501 B-17	d.=5.00		
R3=-40.945 ;到 = ∞ ;主	<u> </u>		
R 4 =-140.591	d = 32.00	n .=1.614977	
R 6 =-187.083	d = 104.32		CYME
	d.=114.72		
			集図

*:非球菌

[0050]

30 【表7】

18

17

-	1-10	保室	٠	м	= -	n

パワー比 : ø1/ø=0.92

	屈折率丸	育
d.=38.00		
d = 15.00	n:=1.525750	
		,
d:=5.00		
		
d:=32.00	n.=1.614977	
d.=56.24		СҮМЫ
d = 162.79	.]	
	d:=15.00 d:=5.00 d:=52.00 d:=56.24	d:=15.00 n:=1.525750 d:=5.00 n:=1.514977 d:=56.24

申: 赤球面

[0051]

*【表8】

帕上惯倍率: M=-1.8

パワー比 : ø』/ø=0.92

曲字半径 R	輸上回旋隔 d	屈折率n ,	作习
R 1 ==-105.513 + K ==-1.0715 a ==-0.11059 g-05	d.=38.00		
a. = 0.80000 E-09 a. = -0.19827 E-12 a. = 0.10780 E-16	d;=15.00	n ₁ =1.526750	
R 2 =-106.424 + K = 1.2965 a = -0.34827 E-06			-
a,= 0.23039 E-09 a,=-0.45024 E-14 a.=-0.24501 E-17	d:=5.00		
R3=-41.038 ; 副 = ∞ ;主			
R 4 =-140.591	d,=32.00	n:=1.614977	-
R 5 = -173.276	d = 30.12		071/2
	d = 188.91		CYM面
			集面

50

字: 序球図

【0052】以上説明したように、本願発明にかかる結 像光学系によれば、アナモルフィックレンズの主走査方 向のパワー∮1と結像光学系の全系の主走査方向のパワ ー∮とのパワー比∮1/∮が、「0≦∮1/∮≦0.1|M|+ 0.45」なる関係を満足するものとすれば、走査角の相

連による横倍率の変動を23%以内に抑制することができ、また、「0≦φ1/φ≦0.1|M|+0.35」 なる関係を 満足するものとすれば、走査角の相違による横倍率の変 動を20%以内に抑制することができる。

【0053】また、このような条件を満足する結像光学

19

系では、像面溶曲図および f θ 特性も良好に収差補正を施すことができ、また f θ 性も良好である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明にかかる結像光学系の第1の実施の形態 を用いた光走査装置を示す主走査断面図(A)および副 走査断面図(B)

【図2】図1に示した光走査装置の結像光学系の、

(A) は像面溶曲図、(B) は f θ 特性図をそれぞれ示 オ

【図3】本発明にかかる第2の実施形態の結像光学系の、(A)は主走査断面図、(B)は副走査断面図、

(C) は像面湾曲図、(D) は f 6 特性図をそれぞれ示す

【図4】本発明にかかる第3の実施形態の結像光学系の、(A)は主走査断面図、(B)は副走査断面図、

(C) は像面湾曲図 (D) は f θ 特性図をそれぞれ示す

【図5】 横倍率変動が23%以上となる結像光学系の一例の、(A)は主走査断面図、(B)は副走査断面図、

(C) は像面湾曲図、(D) は f θ 特性図をそれぞれ示 20 t

【図6】 横倍率変動が23%以上となる結像光学系の他の例の、(A) は主走査断面図、(B) は副走査断面図、(C) は像面溶曲図、(D) はf 6特性図をそれぞれ示す

【図7】横倍率変動が23%以上となる結像光学系の他

の例の、(A) は主走査断面図、(B) は副走査断面 図、(C) は像面溶曲図、(D) は f θ 特性図をそれぞ れ示す

20

【図8】横倍率変動が23%以上となる結像光学系の他の例の、(A)は主走査断面図、(B)は副走査断面図、(C)は像面溶曲図、(D)はf θ 特性図をそれぞれ示す

【図9】横倍率変動が23%以上となる結像光学系の他の例の、(A)は主走査断面図、(B)は副走査断面図、(C)は像面溶曲図、(D)はf θ特性図をそれぞれ示す

【図10】面倒れ補正光学系を適用した結像光学系の一 例を示す図

【図11】面倒れ補正光学系を適用した結像光学系の横 倍率とビーム径の関係を示す図

【図12】走査角の相違によるアナモルフィックレンズ のパワー比 φ₁/φと横倍率変動の関係を示す図 【符号の説明】

11 レーザ光源

12 コリメータレンズ

13 ポリゴンミラー

14 入射光結像光学系

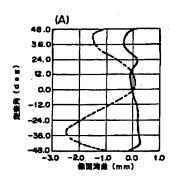
[1] 正メニスカスレンズ

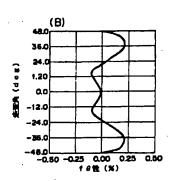
[12] アナモルフィックレンズ

M1 シリンドリカルミラー

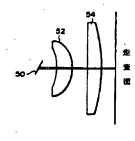
[図2]

【図10】





(11)



【図1】

[図3]

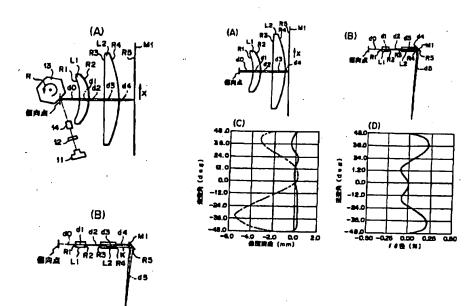
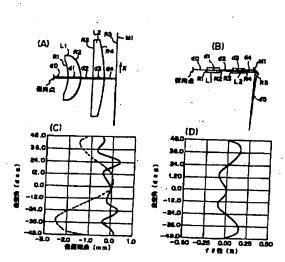
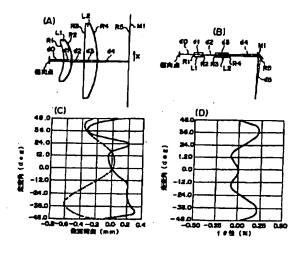


図12]

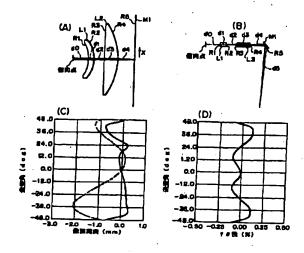


[図4]

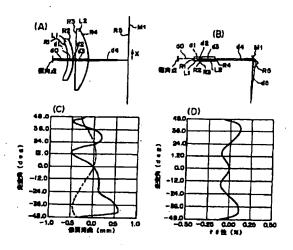
【図5】



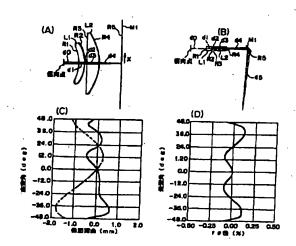
【図6】



【図7】

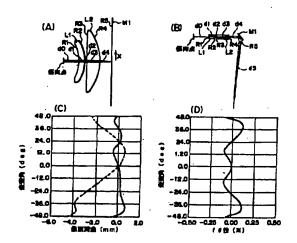


【图8】

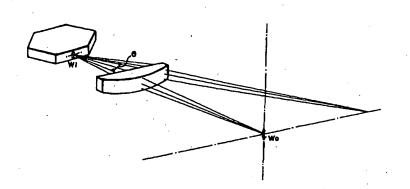


特期平11- 64760

[図9]



【図11】



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Г	Defects in the images include but are not limited to the items checked:
	□ BLACK BORDERS
	☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
	☐ FADED TEXT OR DRAWING
	☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
	☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
	☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
	☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
	☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
÷	☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
	Потипр

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.